3次元シリコン半導体検出器を用いた 電子飛跡型コンプトンカメラの開発

加賀谷 美佳

仙台高等専門学校

片桐 秀明¹, 加藤 凌¹, 東城 直美¹, 鶴 剛², 武田 彩希³, 新井 康夫⁴ ¹茨城大学, ²京都大学, ³宮崎大学, ⁴KEK

便途

査定額:0円 新任のための研究費用:50万

使途

放射線源:10万

- ノートPC:20万
- 直流電源:10万

MPPC:5万

その他、消耗品:5万

Sub-MeV ラインガンマ線観測

Sub-MeV 領域のラインガンマ線観測は非常に重要なプローブ

■超新星残爆発による元素合成の解明
 ■コンパクトな高エネルギー天体からの放射。
 ■ダークマターの間接的な観測

Sub-MeV, MeV 領域の観測は、バックグラウンドガンマ線の 多さから観測が難しく、観測技術の開発や観測が遅れている。

Ex) INTEGRAL/SPI による銀河中心方向や天体の観測
 ⇒まだ観測例は多くない。

本研究では 511 keV やその他 sub-MeV ラインガンマ線を 観測するための検出器開発を目指す。

Important!

Siegert et al. 2016

高エネルギー分解能電子飛跡検出型コンプトンカメラ



ラインガンマ線の検出にはエネルギー分解能の良い半導体が有効

511 keV の電子飛跡

シリコン中の 511 keV ガンマ線による電子飛跡



Calculated by H. Katagiri

based on Mukoyama 1976.

ex) 入射ガンマ線の散乱角: 50° 電子飛跡の長さ:100µm



飛跡の方向を捕らえるには、 ピッチの細かい(数十 μm 程 度)半導体検出器が必要

KEK で開発された 3次元半導体検出器(SOIPIX)に着目

SOIPIX は低消費電力、高速LSI を実現したSilicon-oninsulator (SOI) 技術を搭載したピクセル半導体検出器

XRPIX 2b

<u>XRPIX シリーズの特徴</u>

各ピクセルが比較器回路を保持、イベント検出時のトリガ情報 をピクセルごとに出力することが可能

<XRPIX 2b>

XRPIX シリーズの中で最小のピクセルサイズ (30 µm × 30 µm)

Characteristics	Value
Chip size	6.0 mm×6.0 mm
Pixel size	30 µm $ imes$ 30 µm
BPW size	12μm × 12 μm
Number of pixel	152 × 152
Effective pixel	144 × 144
Effective Area	4.3 mm × 4.3 mm
Thickness of sensor	300 µm



電子飛跡評価用のプロトタイプ検出器を開発 電子飛跡の検出能力を評価

511 keV ガンマ線の電子飛跡を検出できるか XRPIX2b + Csl (Tl) シンチレーション検出器を採用

- 1. XRPIX 2b とシンチレーション検出器の基本性能の評価
- 2. 散乱部と吸収部の同期のための読み出しシステムの開発
- 3. プロトタイプコンプトンカメラ製作
- 4. 511 keV ガンマ線の測定
- 5. データ解析

コンポーネント



今回は光電吸収したエネルギーを検出できればよいため、 検出効率を優先して結晶を採用



各読み出しボードの FPGA ロジックを改良 コインシデンスイベントを取得するための同期システムを開発 (R. Kato, Ibaraki Univ.)



プロトタイプでの測定試験



_{- 2cm} 測定条件 RI: ²²Na (511 keV) 線源の入射角度: 26.5 degrees 散乱角度: 90 degrees 予想される電子飛跡の長さ:~300 µm 温度:-20度 バックバイアス電圧:90 V 閾値: 40 mV

データ解析

以下の手法でイベントセレクション

①クラスタ解析(隣り合ったピクセルが2ピクセル以上) ②散乱部と吸収部のタイミング分布

③エネルギーカット(511 ± 40 keV)





511 keV ガンマ線のコンプトン散乱による電子飛跡の検出に成功。



■読み出しシステム、解析方法は今後も改良が必要
■様々なエネルギーの線源で様々な散乱角度での評価を今後行う

まとめと今後の展望

Sub-MeV ガンマ線観測に特化した3次元半導体検出器を用いた 電子飛跡検出型コンプトンカメラを開発

- ■データ同期システムを開発し、プロトタイプを製作
- ■まだ改良は必要だが、コインシデンスイベントにおける電子飛 跡の取得に成功

Future plan

- ■データ読み出しのシステムの改良
- ■様々な入射角度・散乱角度での評価試験
- ■解析方法の改良
- ■飛跡の散乱方向を決定するための解析方法開発
- ■コンプトンカメラとしての測定・評価